

モデル		ベーシックモデルC3	スタンダードモデルL3	ハイエンドモデルL7	
機能		白色コンフォーカル	白色コンフォーカル レーザーコンフォーカル	白色コンフォーカル レーザーコンフォーカル 微分干渉観察 垂直式白色干渉測定 反射分光膜厚測定	
光源	白色光源	○			
	レーザー光源	-	405nm		
視野/倍率	白色	光源	モニター上倍率 (24インチ)	視野 (H×V)	
		対物レンズ	1×	18.5×	15,000 × 15,000 μm
		2.5×	46.2×	6,000 × 6,000 μm	
		5×	92.5×	3,000 × 3,000 μm	
		10×	185×	1,500 × 1,500 μm	
		20×	370×	750 × 750 μm	
		50×	925×	300 × 300 μm	
		100×	1,850×	150 × 150 μm	
	150×	2,775×	100 × 100 μm		
	レーザー	50×	1,850×	-	150 × 150 μm
100×		3,700×	-	75 × 75 μm	
150×		5,550×	-	50 × 50 μm	
ズーム機能		1×～8×			
画像情報		輝度	1,024×1,024×12 bit / 高精細モード2,048×2,048×12 bit		
		高さ	1,024×1,024×16 bit / 高精細モード2,048×2,048×16 bit		
フレームレート		15 Hz～120 Hz			
幅測定	最小測定単位	0.001 μm			
	正確さ	± [ 0.02 × (100/対物レンズ倍率) + L /1000 ] μm			
	繰り返し性 (3σ) <sup>※1</sup>	10 nm			
高さ測定	スケール分解能	0.05 nm			
	正確さ	± (0.11+L/100) μm			
	繰り返し性 (σ) <sup>※2</sup>	10 nm			
	測定範囲 <sup>※3</sup>	7 mm			
Zストローク		100 mm	80 mm		
レボルバー		5穴電動レボルバー (レンズ位置自動認識機能付き)			
XYステージ	マニュアル	○		-	
	電動	オプション		○	
微分干渉観察機能		オプション		○	
垂直式白色干渉測定機能		オプション		○	
位相シフト干渉測定機能		オプション			
反射分光膜厚測定機能		オプション		○	
ソフトウェア	画像取得	HDRモード、パッチワーク、マルチゲイン、等			
	画像処理	表面補正 (傾き、球面)、ノイズ除去、フィルター、カラー抽出、二値化、等			
	形状解析	プロファイル計測、比較計測、表面粗さ測定、幅・ピッチ計測、膜厚計測			
	データ出力	専用拡張子、汎用画像ファイル、CSVファイル、STEPファイル			
	効率化ツール	LMカルテ、フィルターアシスト、マクロ機能、粗さサジェスト、Officeレポート			
ユーティリティ		AC:100 V 50/60 Hz 約800 VA			
サイズ・重量	顕微鏡本体	382 (W) × 511 (D) × 689 (H) mm 約40 kg			
	コントロールユニット	430 (W) × 450 (D) × 100 (H) mm 約7 kg			
	LED光源ユニット	142 (W) × 279 (D) × 210 (H) mm 約3.8 kg			
	ランプハウス	142 (W) × 311 (D) × 227 (H) mm 約6.7 kg			
	制御用パソコン	175 (W) × 440 (D) × 360 (H) mm 約9 kg			
	モニター	556 (W) × 180 (D) × 513 (H) mm 約4 kg			
トレサビリティ対応		○			

※1 振動のない環境で基準パターンを対物レンズ100× (NA0.95) を使用して測定した時の値です。

※2 振動のない環境でVLSIスタンダード社の標準段差を対物レンズ100× (NA0.95) を使用した時の値です。

※3 使用する対物レンズの作動距離以内となります。